

Bac De Décapage Acide Sans Soudure À Trop-Plein Intégré En Ptfé - Cuve De Nettoyage Semi-Conducteur En Fluoropolymère Sur Mesure

Numéro d'article: PL-CP388



Introduction

Réservoirs à trop-plein en PTFE hautes performances et bacs de décapage sans soudure conçus pour une résistance chimique extrême et des applications haute pureté. Des conceptions intégrées entièrement personnalisables garantissent zéro fuite et une durabilité maximale dans les procédés industriels exigeants de gravure acide et de nettoyage de semi-conducteurs pour tous les opérateurs industriels.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Nettoyage de plaquettes semi-conductrices	Élimination critique des contaminants organiques et inorganiques des plaquettes de silicium par gravure RCA ou piranha.	La pureté ultra-élevée garantit zéro contamination par des métaux traces.
Gravure de cellules photovoltaïques	Texturation de surface précise du silicium de qualité solaire à l'aide de solutions acides ou alcalines concentrées.	La conception sans soudure résiste à la nature agressive des produits chimiques de texturation.
Décapage de surfaces métalliques	Élimination haute performance des oxydes et des calamines des composants métalliques de précision et des implants médicaux.	La durabilité à long terme réduit les coûts de remplacement de l'équipement dans les environnements corrosifs.
Verrerie de laboratoire pour analyse de traces	Préparation et stockage d'échantillons dans des environnements où une précision de l'ordre des parties par milliard (ppb) est requise.	Le matériau non lessivable empêche toute interférence sur l'échantillon pendant l'analyse.
Recherche et développement de batteries	Test et confinement des électrolytes et des produits chimiques corrosifs utilisés dans les architectures de batteries de nouvelle génération.	Une résistance thermique supérieure permet de gérer les réactions exothermiques en toute sécurité.
Galvanoplastie et anodisation	Cuve de stockage pour des bains de placage spécialisés où la haute pureté et la résistance chimique sont obligatoires.	Le trop-plein intégré maintient des niveaux de bain constants pour un revêtement uniforme.
Synthèse pharmaceutique	Réacteur pour la production de principes actifs pharmaceutiques (API) impliquant des réactifs agressifs.	Le matériau biologiquement inerte garantit le respect des normes de pureté strictes.
Stockage et transfert de produits chimiques	Confinement sûr des réactifs haute pureté qui dégraderaient les récipients en verre ou en acier inoxydable.	La construction à paroi robuste empêche la perméation et la contamination environnementale.

Paramètre	Détail de la spécification pour PL-CP388
Identifiant du modèle	Série PL-CP388
Matériau principal	PTFE haute pureté 100% vierge (options PFA disponibles)
Méthode de construction	Usinage monolithique complet CNC (sans soudure)
Configuration de conception	Cuve à trop-plein interne et externe intégrée
Plage dimensionnelle	Entièrement personnalisable selon les spécifications du client

Application	Description	Avantage clé
Paramètre	Détail de la spécification pour PL-CP388	
Épaisseur de paroi	Personnalisable (optimisée pour l'intégrité structurelle et le transfert thermique)	
Plage de température de fonctionnement	-180°C à +260°C	
Compatibilité chimique	Universelle (à l'exception des métaux alcalins fondus et du fluor élémentaire)	
Type de déversoir de trop-plein	Personnalisable (options : droit, en V, dentelé)	
Finition de surface (Ra)	<0,5 µm (standard) / Personnalisable pour une plus grande précision	
Drainage et orifices	Raccords personnalisés NPT, à bride ou à compression disponibles	
Capacité de charge	Conçue en fonction du volume personnalisé et de la densité du fluide	
Protocole de nettoyage	Compatible avec les procédures standard de salle blanche et de stérilisation	